

## MEMS 装置操作研修

日 時 平成26年 11月4日 (火)

会 場 NICOナノテク研究センター ながおか新産業創造センター(NBIC)内

## 【開催のご案内】

MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)技術は、半導体製作技術を機械構造の加工に応用したものです。加速度センサー、インクジェットプリンタ用ヘッド、圧力センサーなどは MEMS 技術を利用した代表例で、これらは自動車、家電、情報・通信、医療・バイオなど多くの分野で用いられています。

本研修では、スパッタリング、エッチング、ダイシングなど、MEMS 加工の要素技術について理解を深めて頂くため、講義と MEMS 装置の操作実習を行います。

普段の業務の中で「MEMS など縁がない」という方も、その特徴的なプロセスは多くのヒントを与えてくれるものと思います。多くの皆様からご参加賜りますようご案内申し上げます。

日 時 : 平成 26 年 11 月 4 日 (火) 13:00~16:00

会 場 : NICO ナノテク研究センター ながおか新産業創造センター(NBIC)内

長岡市深沢町 2085-16 <http://nbic.jp>

定 員 : 4 名程度 (申込み多数の場合には、抽選とさせていただきます)

参加費 : 無 料

申込方法 : 裏面参加申込書にご記入の上、メールまたはファックスにてお申込ください

申込締切 : 平成 26 年 10 月 29 日 (水)

## 申し込み・お問い合わせ先

新潟県工業技術総合研究所

レーザー・ナノテク研究室

(長岡市深沢町2085-17)

TEL:0258-47-5171

FAX:0258-47-5172

URL : <http://www.iri.pref.niigata.jp>Mail : [claser@iri.pref.niigata.jp](mailto:claser@iri.pref.niigata.jp)

